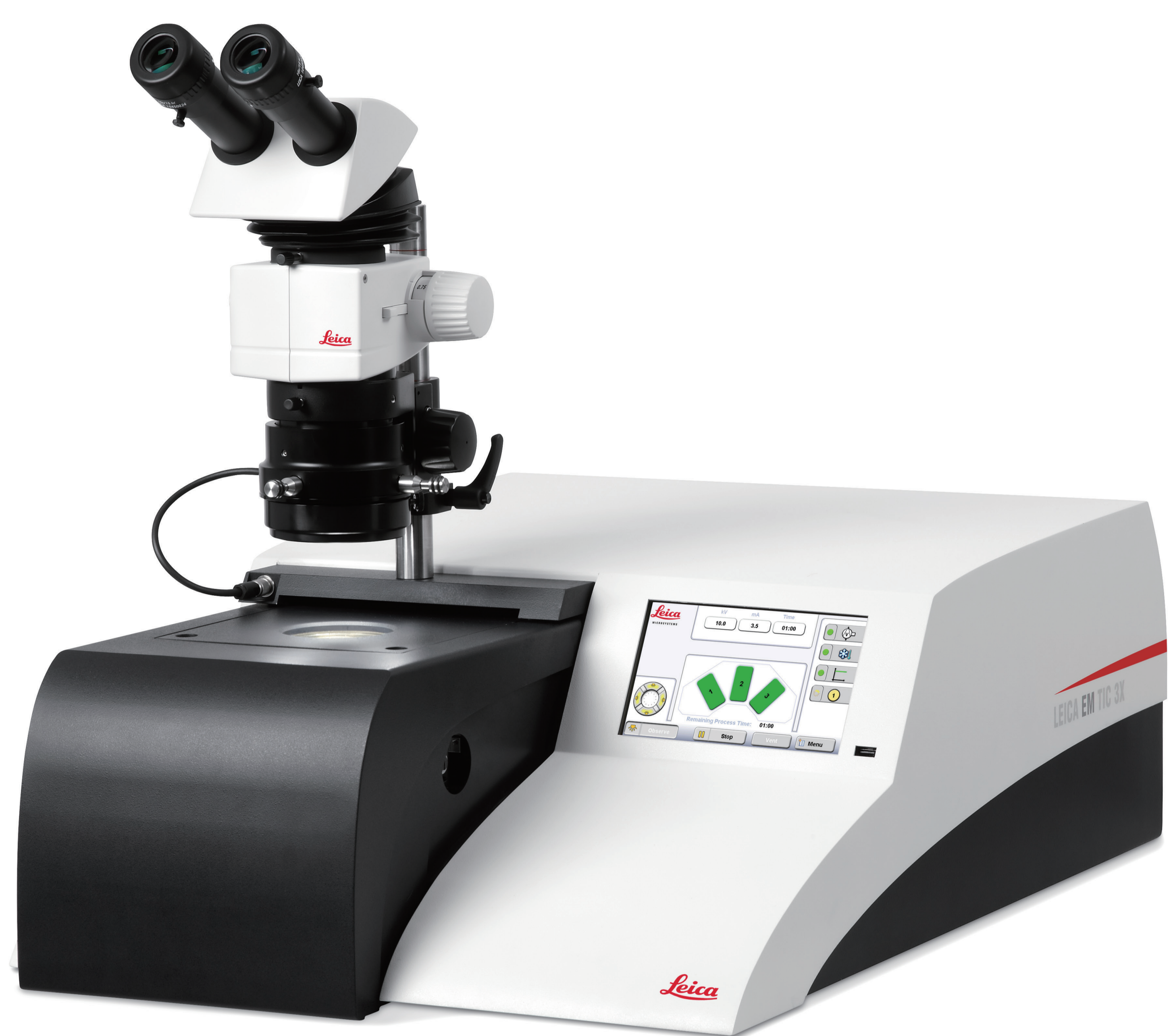


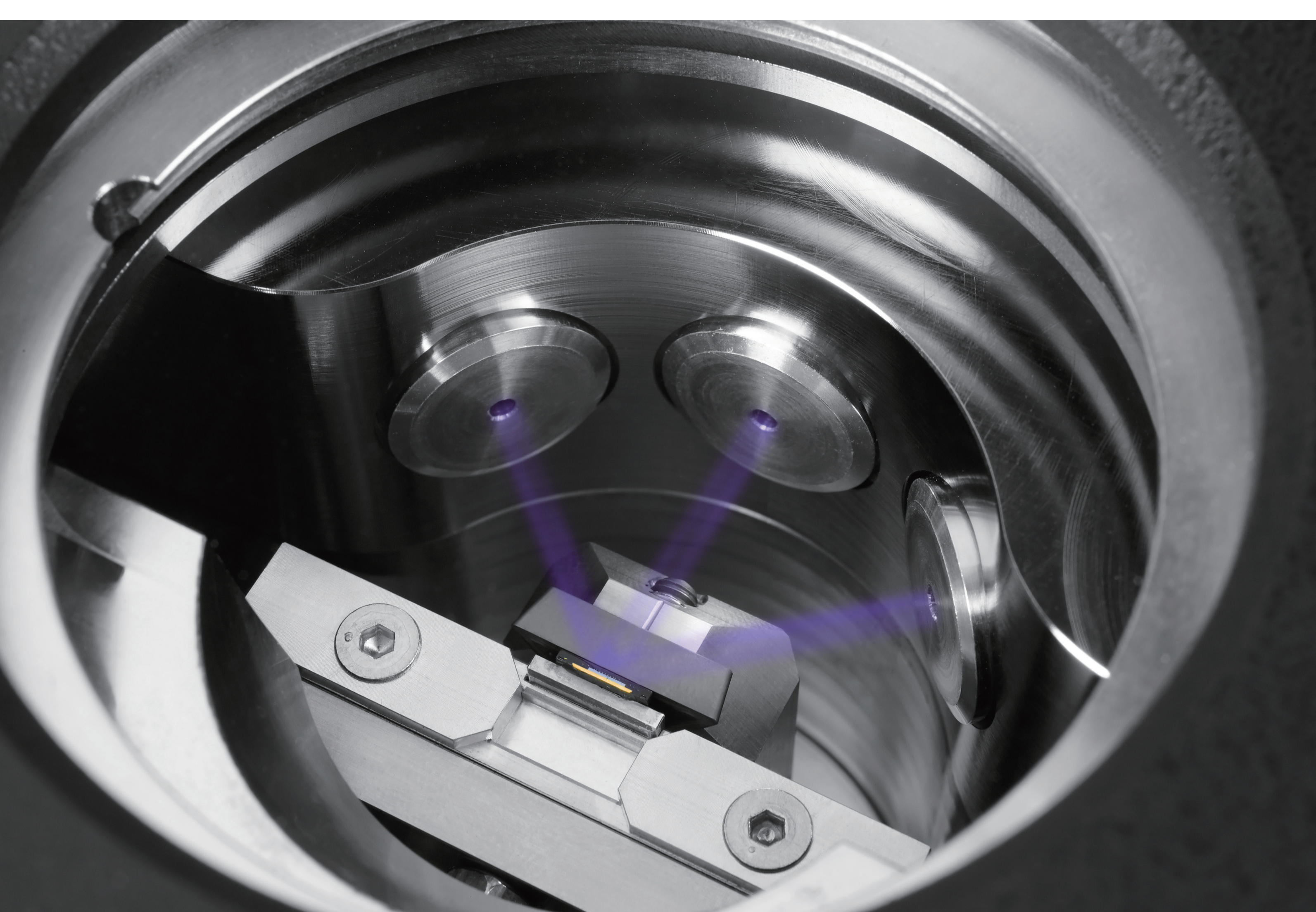
From Eye to Insight

Leica



Leica EM TIC 3X 三离子束切割仪

离子束侧面轰击样品，获得高质量无应力“切割”截面，以便于SEM观察，及EDX或EBSD等分析。并可对样品进行离子束平面抛光，抛光区域达25mm。



适用于多层膜材料、软硬复合材料，金属、陶瓷、地质等各种材料。操作简单，不需要摸索条件即可获得理想的样品截面，使样品暴露内部细微结构信息。



High Quality Surface Finishing For
Many Materials!



立刻拨打 400-650-6632
www.leica-microsystems.com.cn